フォノン導波路やフォノニック結晶を 用いた弾性波の制御

エレクトロンやフォトンと同じように、身近に存在する音や熱に もフォノンと呼ばれる格子振動の素励起があります。信号処理デバ イスや通信システムにおけるエレクトロンやフォトンの重要性とは 対照的に、フォノンの制御技術は未発達だったため情報担体として の活用は極めて限定的でした。本稿では、電気機械フォノニック結 晶という新しいプラットフォームを用いて、フォノンのオンチップ 制御技術の向上に取り組んだこれまでの研究成果について解説します。



NTT物性科学基礎研究所

情報担体としてのフォノンの 可能性

フォノンは物質を構成する原子や格 子振動の素励起です.特に,振動数が 10⁴~10¹¹ Hzのものを超音波と呼び, エコーやソナーのような生体や水中内 の観測・探査システムの信号源として 古くから利用されてきました⁽¹⁾.一 方,情報処理システムにおいては,超 音波を含むフォノンは、デバイスの駆 動過程で生じる副産物であり,正常な 動作を乱す障害物としてみなされ,情 報担体としての利用はこれまで積極的 に試みられていませんでした.

次世代の情報担体として注目を集め るフォトン(光)も、元々は顕微鏡等 の観測分野での応用にとどまっていま した、その後、プラナー光波回路や フォトニック結晶などの新しいプラッ トフォームが登場したことで、チップ スケールでの制御技術が向上した結 果、現在の産業的価値が見出されまし た、フォノンはフォトンと同様に波動 性を持ち、その挙動に類似性がありま す.また,同一周波数で比較すると波 長が5桁も短く,さらに,自由空間へ の輻射がなくエネルギー損失が少ない という優れた特徴もあります⁽¹⁾.将来 のIoT (Internet of Things)社会に おいて,高周波情報処理システムのさ らなる小型化,省エネ化への要請はま すます高まっていくため,短波長かつ 低損失なフォノンの情報担体としての 活用が有望視されます.そのために は、フォトンのように、フォノンにも オンチップで多様な制御ができるプ ラットフォームが必要になります.

フォノニック結晶とマイクロ電気 機械システム

フォノンの制御プラットフォームと して、フォノニック結晶とマイクロ電 気機械システム(MEMS)が古くか ら知られています、前者は、異なる弾 性体の周期構造から成る人工音響構造 で、フォトニック結晶のフォノン版に なります⁽¹⁾(図1(a))、周期間隔 (α)を、フォノンの波長(λ)程度 にすると、構造がつくる弾性周期ポテ ンシャルの影響を受け、フォノンの分



a) フォノニック結晶の一例(模式図). 柱が規則的に並ぶことで,異なる弾 性体の周期構造を形成しています.



(b) マイクロ電気機械システムの一例(模式図).梁 が両端で固定された両持ち梁(ビーム)構造をしています。

図1 フォノニック結晶とマイクロ電気機械システムの模式図

散関係^{*1}が変調されます.例えば, ブラッグ条件 (*n*λ =2α, *n*は自然数) を満たす周波数近傍にはバンドギャッ プ^{*2}が発生し,波長λを持つ波は伝 搬できなくなります.さらに,バンド ギャップの形成により分散曲線が緩や かになり,その傾斜で決まる群速度も 低下します.フォノニック結晶を用い れば,その周期構造を通して,フォノ ンの空間的な伝搬制御が可能になりま す.それゆえ,フォノニック結晶は音 響工学の分野において,遮音器などの 音響波制御システムの基本構造として 利用されてきました.

一方, MEMSは主に半導体工学等 のエレクトロニクス分野において精力 的に研究されてきました. これはカン チレバーやビームのようなnm, μm スケールの立体梁構造からなり、オン チップかつ電気的に超音波振動を励起 できます⁽²⁾(図1(b)).また、梁と基板 間では、振動の伝わりやすさを示す音 響インピーダンス差が大きいことから、 弾性振動の基板への流出が抑えられ, 振動の持続時間が長い(高いQ値*3) の) 共振を保持できます。近年、これ ら振動子において顕著に現れる非線形 効果に着目した, 振動の非線形ダイナ ミクスやそれを応用した動的制御技術 に関する研究に学術的な注目が集まっ ています. これまでに. パラメトリッ ク効果*4や四波混合*5を介した、フォ ノンの増幅や周波数変換といった振動 の外部変調が実証されています、この ように、MEMSはフォノンの動的な 制御ができる一方で、 局所的な構造の ため, 空間的な伝送はできません. 対 照的に、フォノニック結晶は動的な制

御性はありませんが,空間的な制御性 を有しています.

両者の特徴を比較すると、その機能 に相補的な関係があることが分かりま す.私たちはこの点に注目して、2つ の異なる構造を融合した「電気機械 フォノニック結晶」という新しいフォ ノンの制御プラットフォームを提案し ました^{(3).(4)}.これを用いると、フォ ノンのオンチップ励振や空間伝送、そ の動的制御を同じデバイス上で実現で きるようになります.

電気機械フォノニック結晶

図2(a)に示すように、電気機械フォ ノニック結晶はガリウムヒ素(GaAs) を媒質に持つ直径22 µmの円形薄膜 (メンブレン)が8 µmの間隔で100 個一列に周期的に連結した導波路構造 から構成されています⁽⁴⁾. メンブレン と基板の間は中空になっており、太鼓 の膜のように振動します. GaAsは圧 電性*⁶を有しているため、メンブレ ン上に設置した電極に交流電圧を加え ることで、メンブレンの上下振動(超 音波フォノン)を誘起することができ ます. この弾性振動はメンブレンの連 結方向に沿って伝わっていきますが、 その過程で周期孔がつくる弾性ポテン シャルの影響を受け、分散関係が変調 されます. 数値計算から求めた分散関 係と、フォノン伝搬の周波数依存性を 実際に測定した結果を図2(b)に示し ます. 上図の分散関係では. 1番目の バンド(黄色)が3.5 MHzから7.4 MHzにわたって形成されています. このバンドがフォノンの伝搬を促しま すので、 図下部の実験結果においても、

導波路の一端から励起されたフォノン がその他端まで伝搬していることが確 認できます.このバンドは7.4 MHzで 分散関係の端に到達します(波数 $k=\pi/\alpha$)、次のバンド(水色)が 生じる周波数までの間に、灰色で示し た空隙が生じています.これがバンド ギャップです.ここではちょうどフォ ノンの半波長が孔間隔に一致しブラッ グ条件を満たすため($\lambda/2=\alpha$)、 フォノンは孔の位置でブラッグ反射^{*7} を受けます.実際に、バンドギャップ の位置で、フォノン伝搬が著しく抑制

- *1 分散関係(曲線):波の波数と周波数間の 関係性.波数は波長の逆数で,運動量と比 例関係にあります.この関係から周波数に 対応した波数が一意に決まり,伝搬速度な どの基本的な波の伝搬特性が決定します.
- *2 バンドギャップ:波の周波数に対して分散 が決まらない、つまり対応する状態が存在 しない周波数帯域のことを意味します.波 長と媒質の周期間隔が特定の条件(ブラッ グ条件)を満たす周波数において発生しま す.ここでは、周期構造から強い反射を受 け、波の伝搬が強く抑制されます.
- *3 Q値:共振周波数(f_{res})の半値全幅(Δ f_{res},緩和時間の逆数)に対する比によって 表される振動の質や寿命の評価に用いる無 次元性能指数(Q=f_{res}/Δf_{res}).
- *4 パラメトリック効果:周波数の異なる波が 混合し、それらの和もしくは差の周波数成 分を持つ新しい波が発生する現象です. MEMSの場合、外部信号により振動子内の 張力を周期的に変調することで実現します.
- *5 四波混合:三次の非線形効果を介して行われる波の周波数変換法です。周波数f,と周波数f2の異なる2つの波を同時に入力すると、このプロセスを通して新しい周波数の波(f3, f4)が発生します。なお、f3とf4はエネルギー保存則を満たすようその値が決まります(f,+f2=f3+f4).
- *6 圧電性:物体に電圧を加えると歪が生じる 現象.電気機械フォノニック結晶では、こ の歪により、曲げモーメントが発生し、メ ンブレンの垂直方向に振動が発生します.
- *7 ブラッグ反射:原子が周期的に並んだ格子 面に角度 θ で波が入射する場合,その波長 (λ)と隣接する格子面間隔(α)がブラッ グ条件を満たす場合 ($n\lambda = 2\alpha \sin \theta$, nは自然数),反射に強い干渉が現れる現象. 本実験における一次元系では, $\theta = \pi/2$ となります.





されていることが分かります.また, バンドギャップにより,接する分散曲 線の傾斜が緩やかになるため,フォノ ンの伝搬速度(群速度)が徐々に低下 していくはずです.その現象を実験で 確かめた結果が図2(c)です.3.5 MHz から7.0 MHzまでは,伝搬速度は周波 数とともに増加していますが,その後 は,反転して減少していることが確認 できます.このことから,バンドギャッ プや群速度変調の発生を実験的に確認 し,本構造がフォノニック結晶として 機能していることが分かります.

フォノン波束エンジニアリング

フォノニック結晶効果の実用例とし て、フォノンの波束制御の研究につい て紹介します.この導波路は、群速度 分散と呼ばれる、 伝搬速度が周波数に よって変化する特徴を有しています. ここに、包絡線が有限の幅を持つ波束 (パルス)を入力します.波束には, フォノンの振動周波数(搬送周波数) に加え、近傍の周波数成分の波も含ま れています. したがって, 群速度に分 散がある場合,各々の周波数に応じた 速度でそれぞれの周波数の波が進むた め、それらを包括する波束は伝搬とと もに拡がっていきます. このような波 形の歪を誘起する群速度分散は、通常 の導波路において望ましくない特性で すが、私たちはこれを積極的に利用し、 フォノン波の圧縮や拡大といった波束 制御を実現しました.

負の周波数変調(チャープ, C<0)を加えたフォノン波束を導波 路の一端から加えます. ここでチャー プ定数(C)の符号は、周波数が時間と ともに増大, または, 減少するかを決 めます. 搬送周波数を5.8 MHzに選ぶ と,この導波路では、高い周波数の フォノンのほうが低い周波数よりも速 く伝搬していきます(図2(c)). 負の チャープでは、入力時に高周波数の波 が波束前方に低周波数の波が後方にい るので, 伝搬とともに高周波数の波は より先に進み,低周波数のそれはさら に遅れるため,結果的に波束は拡大し ていきます.反対に,正のチャープを 入力すると、今度は波束前方に低周波 数,後方に高周波数の波が偏在してい ることになりますので、同じメカニズ ムでも、この場合は伝搬とともに波束 が圧縮していきます (図3(a)). 図3(b)



(a) 正チャープ信号 (C>1)の波束圧縮の模式図. 波束前方から後方に 移るにしたがって, 波の周波数が増加しています.

はこれを実験的に確かめた結果です.

ここでは、さまざまなチャープ定数(C)

で入力した波束幅の伝搬距離依存性を

プロットしています. 前述のとおり,

C = -3 の負のチャープ入力では、波

束幅が距離に比例して増加している一

方で、C=3の正チャープ入力では波

束幅が減少していることが分かりま

す. しかし, 距離7 mmを超えると波

束の変化が,一転,圧縮から拡大へと

転じています. これは, 入力時の

チャープによる波の偏在が解消された

ためと理解できます.また、周波数掃

引範囲を広げると,この圧縮効果も強

くなります.実験では,C=3から9.7

へ増やしたところ, 波束幅が 2 µsか

ら測定装置の分解限界値である0.6 µsまで圧縮しました.このように、

フォノニック結晶の特異な分散関係を

用いて、伝搬フォノンの波束形状を制

御することができます. この実験では

入力にチャープ信号を使いましたが,

図3 群速度の分散による波束形状の変化

後述する非線形効果を合わせて用いれ ば、無変調の入力信号からフォノン波 束の圧縮・拡大を実現することも可能 です⁽⁵⁾.

フォノン伝搬のスイッチング

電気機械フォノニック結晶が持つ MEMSの特性を活用すれば、フォノ ン波の動的制御も可能です⁽³⁾.ここで は、導波路の中央に設置したメンブレ ン振動子を外部変調用ノードとして使 います (図4(a)). このメンブレンは 隣接するメンブレンとの結合が弱いた め,3 MHz以下の低周波数領域では 単一のMEMS共振器として振る舞い ます. それゆえ, 表面に設置した電極 から交流電圧を加えることで、 導波路 の伝搬モードから、スペクトル的に独 立し、振動がメンブレン内に局在した 共振を励起できます. これを強く励起 すると、大きな振動振幅によりメンブ レン内の応力分布が再調整されます.

(b) さまざまなチャープ定数(C)の入力 波における波束幅の伝搬距離依存性

その結果、中央のメンブレン振動子を 通過する導波路のフォノン波もこの弾 性特性の変化から影響を受け、伝搬ス ペクトルが変調します. 伝搬波の振動 周波数を適切に調整すれば、フォノン の伝搬強度が低下することになりま す. それを実験的に確かめた結果が図 4(b)になります. ここでは, 5.745 MHzの伝搬波を連続波として導波路 端から加え、同時に、メンブレン振動 子から1.855 MHzの共振を1.0 msの 間隔で周期的に加えたときの、伝搬波 の他端での振動強度を時間領域で測定 しています.確かに、中央のメンブレ ンが振動しているときだけ、伝搬強度 が低下していることが分かります.こ のように、外部から変調信号を電気機 械フォノニック結晶に加えることで, フォノン波伝搬の動的な制御が可能に なります.

本稿では説明を割愛しましたが、このほか、振動エネルギー転送や全機械

特集



 (a) MEMS振動子ー導波路の電子顕微鏡写真とスイッチング測定の 構成図. MEMS振動子の共振と伝搬波の振動形状を挿入図に示 します.



(b) フォノン伝搬のスイッチング. MEMS振動子のオン・ オフに伴い, 伝搬波の出力が変調されています.

図4 電気機械フォノニック結晶によるフォノン伝搬の動的制御

ランダムアクセスメモリ操作, さらに, フォノン伝搬波の周波数変換も, MEMSの非線形効果を用いて成功し ています.

さらなる高周波化とマグノンとの 融合

電気機械フォノニック結晶を基盤に すれば、オンチップで空間的かつ動的 なフォノン制御を実現できます.しか し、その動作周波数は数MHzと低く、 実用性を追求するためには、極超音波 と呼ばれるGHz帯まで周波数を引き 上げる必要があります.私たちは、最 近、この極超音波デバイスの作製にも 成功しました⁽⁶⁾.また、マグノンと呼 ばれる強磁性スピン波を活用した極超 音波フォノンの動的制御の研究にも取 り組んでいます.本稿で説明した電気 機械フォノニック結晶のフォノン制御 技術と組み合わせることで、高周波で 動作するフォノニック能動素子やそれ らを集積したフォノン波回路の構築が 可能となり、情報担体としてのフォノ ンの有用性が飛躍的に高まると私たち は期待しています.

■参考文献

- M. Maldovan: "Sound and heat revolutions in phononics," Nature, Vol. 503, pp. 209-217, 2013.
- (2) K. L. Ekinci and M. L. Roukes: "Nanoelectromechanical systems," Review of Scientific Instruments, Vol.76, No.6, June 2005.
- (3) D. Hatanaka, I. Mahboob, K. Onomitsu, and H. Yamaguchi : "Phonon waveguides for electromechanical circuits," Nature Nanotechnology, Vol.9, No.7, pp. 520-524, July 2014.
- (4) M. Kurosu, D. Hatanaka, K. Onomitsu, and H. Yamaguchi : "On-chip temporal focusing of elastic waves in a phononic crystal waveguide," Nature Communications, Vol.9, No.1331, 2018.
- (5) M. Kurosu, D. Hatanaka, and H. Yamaguchi: "Mechanical Kerr Nonlinearity of Wave Propagation in an On-Chip Nanoelectromechanical Waveguide," Phys. Rev. Applied 13, 014056, Jan. 2020.
- (6) D. Hatanaka and H. Yamaguchi : "Real-Space Characterization of Cavity-Coupled Waveguide Systems in Hypersonic Phononic Crystals," Phys. Rev. Applied 13, 024005, Sept. 2020.



(左から) 畑中 大樹/ 黒子 めぐみ/ 山口 浩司

振動や熱といったフォノンを信号処理 に使うという考えは、洗練されたエレク トロニクスやフォトニクスからみると、 非現実的に聞こえるかもしれません.だ からといって全く価値がないとはじめか ら見切るのでなく、その潜在性に注目し て、有用性を確かめ、社会的価値を引き 出すことが、基礎研究に携わる者の責務 だと思い、日々研究に取り組んでいます.

◆問い合わせ先

NTT物性科学基礎研究所 フロンティア機能物性研究部 ナノメカニクス研究グループ TEL 046-240-2518 FAX 046-240-4317 E-mail daiki.hatanaka.hz@hco.ntt.co.jp